あいちシンクロトロン光センター成果発表会 2016年3月9日(水) ミッドランドホール

BL5S2 粉末回折ビームラインにおける 平面型二次元検出器の4連装化 井田隆<sup>1,2,3</sup>,尾野翔器<sup>1</sup>,八反大貴<sup>1</sup>,和智健人<sup>1</sup>,

立木翔治<sup>2</sup>,中西裕紀<sup>2</sup>,佐久間靖博<sup>2</sup>,和田明生<sup>2</sup>, 砥綿真一<sup>2</sup>

<sup>1</sup>名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター

2科学技術交流財団 シンクロトロン光センター

<sup>3</sup> International Centre for Diffraction Data





AichiSR





## 背景

放射光粉末回折計,装置スタディ,検出器 測定誤差とデータ解析

### ピクセル型二次元検出器4連装化の概要

## 実験と解析の例

Sulyanov et al. (1994) の方法

PILATUS 強度データのマッピング

平均ピクセル強度とその標準偏差の算出

区分データの接続と重みつき最小二乗フィッティング

平面型検出器の位置と角度の調整

### まとめ





分解能バックグラウンド× 測定時間







将来性・信頼性

BL5S2

× 将来性・信頼性





分解能 バックグラウンド 測定時間 信頼性



分解能 バックグラウンド 測定時間 信頼性

#### 背景2 測定誤差とデータ解析

粉末回折測定の系統誤差

概ね解決されてきた。

粉末回折測定の統計誤差

大強度,高分解能,微量試料測定ほど誤差評価が困難

最小二乗法の粉末回折データ解析への応用 [Rietveld, 1969]:

放射光粉末回折データでは構造パラメータの誤差が過小評価される傾向

最尤推定法の粉末回折データ解析への応用 [Ida & Izumi, 2011]:

統計誤差モデルが未知パラメータを含んでも

観測されたデータから統計モデルを最適化できる。

構造パラメータの誤差を正しく推定しうる。

誤差モデルが正しくなければ無意味かもしれない。

二次元検出器を使えば観測強度の統計的な変動を実測しうる。

最小二乗法でも最尤構造推定が可能



# AichiSR BL5S2の 4-PILATUS100K + 円筒型 IP カメラ



#### PILATUS を使った 高分解能測定 (ピクセル分解能 0.01°)

8 ショットで -2° ~ 99°

測定時間の目安: 30 min





# AichiSR の 4-PILATUS 100K

ワンショット配置 (ピクセル分解能 0.06°) PILATUS#4, 170 mm 170 mm 1ショットで PILATUS#3 -1° ~ 101° 170 mm PILATUS#2. 最大 100 試料連続 自動測定可能 PILATUS#1, 170 mm になる予定 x-ray 測定時間の目安: 10-20 s Goniometer Angle: 13.0° 20 coverage: -1° ~ 101° (1-shot) フレームレート: 300 Hz 日日 

## AichiSR の 4-PILATUS 100K



### 二次元ピクセル強度データの処理

Sulyanov et al. (1994) の方法

すべてのピクセルの各ピクセル毎に中心位置の  $2\theta$  値を計算し,

ピクセル強度に非球面(カメラ長)補正,斜入射補正,偏光補正をかけ, 離散的な 20 値で区切った「強度 bin」の該当する bin に足しこみ, 同時に同じ区切りの「ピクセル数 bin」の該当する bin に1を足す。 最後に bin ごとに積算強度を積算ピクセル数で割る

子午線位置での仮想的な平均ピクセル強度が求まる。

平面型検出器のピクセル 2θ と補正因子(直線偏光を仮定):

$$2\theta = \arccos \frac{R\cos 2\Theta - Y\sin 2\Theta}{\sqrt{R^2 + X^2 + Y^2}}$$
$$f_{\text{flat}}(X, Y) = \frac{\left(R^2 + X^2 + Y^2\right)^{3/2} \left(R^2 + Y^2\right)}{R^5}$$

R:カメラ中心距離 2Θ:カメラ中心角度 X:ピクセル横方向位置 Y:ピクセル縦方向位置



子午線



#### 誤差の逆数の重みつきをつけた最小二乗法によるフィッティング



誤差	実験値	平均強度平方根
R <sub>wP</sub> (%)	0.86	2.81
R <sub>P</sub> (%)	2.93	1.88
R <sub>B</sub> (%)	3.61	3.14
S	2.98	1.08
<i>a</i> (Å)	4.9307(4)	4.93026(9)
<i>c</i> (Å)	5.4236(2)	5.42342(6)

RIETAN-FP (Izumi & Momma, 2007)
プロファイル: <u>対称擬 Voigt 関数</u>
ピークシフト:定数シフト
ピーク幅:Caglioti <i>et al.</i> (1958)
バックグラウンド:11 次多項式
石英, trigonal, P3121 (S.G. #152)
原子散乱因子:中性原子
分散補正: Cromer & Liberman (1981)
等方性原子変位因子

← 有効数字少なめ

### PILATUS100K 四連装化の課題

検出器の調整と較正の高精度化・効率化 No.1 検出器の調整・較正は容易。 どこまで精度をあげられるか調査中。 No.2, No.3, No.4 検出器の較正は単純ではない。 ワンショット配置のデータ処理 複数の異なる手法を検討中

二次元データ 1次元データ化の効率化 検出器ごとの装置パラメータが決まれば後の処理は容易 検出器ごとに異なる感度の補正

データ接続の効率化

ずらして拡大縮小して平均化

ずれの原因 メカニズムの問題

将来はフーリエ変換を使った順逆フーリエ変換処理も?

実験と解析



実測回折強度図形 試料 LaB<sub>6</sub> @ RT カメラ長 340 mm 露光時間 54 s x 3 times

実験と解析



ピーク形状モデル関数: ベータ分布の確率密度関数 有界かつ連続 平均,標準偏差,歪度,尖度を定義可能





→エンコーダ利用により改善のみこみ

等方性原子变位, 無配向 一様強度分布, 円柱形状吸収補正





# 平面型検出器の位置と角度の調整

#### 二次元回折図形に対する模擬曲面のカーブフィッティング





模擬曲面 等幅 Gauss 型関数の線形結合 強度の二次元マッピング 検出器の位置と角度を最適化

まとめ

AichiSR BL5S2 粉末回折ビームラインにおいて,二次元検出器 PILATUS を四連装化した。

通常目的では一試料測定の所要時間は約3分。

誤差評価が可能。リートベルト法でも最尤推定構造解析可能。

実測回折ピーク形状は,有界な変数域で定義されるベータ分布の確率密度関数で 良くモデル化される。

→リートベルト解析で伝統的に用いられてきた「不連続なピーク形状関数(打ち 切り型 Gaussian, Lorentzian, Voigt, 擬 Voigt 関数…) モデル」の不都合を解消しうる?

平面型検出器の位置と角度の微調整(較正)の全自動化が進行中。